|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование квалификации** | **Наименование и реквизиты профессионального стандарта, на соответствие которому проводится независимая оценка квалификации** | **Уровень (подуровень) квалификации, в соответствии с профессиональным стандартом** | **Положения профессионального стандарта** | | | **Квалификационное требование, установленное федеральным законом и иным нормативным правовым актом Российской Федерации, и реквизиты этого акта** | **Перечень документов, необходимых для прохождения профессионального экзамена по соответствующей квалификации** | **Срок действия свидетельства о квалификации** | **Дополнительные характеристики (при необходимости): наименование профессии рабочего, должности руководителя, специалиста и служащего в соответствии с ЕТКС, ЕКС с указанием разряда работы, профессии/категории должности/класса профессии** |
| код трудовой функции | наименование трудовой функции | дополнительные сведения (при необходимости) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Техник-лаборант по измерению параметров наноматериалов и наноструктур | Специалист по измерению параметров и модификации свойств наноматериалов и наноструктур | 5 | А/01.5 | Подготовка к проведению измерений параметров наноматериалов и наноструктур |  |  | 1. Документ,  подтверждающий наличие среднего профессионального образования  по программам  подготовки  специалистов  среднего звена  по специальностям «Микроэлектроника и  твердотельная  электроника»;  2.Дополнительные профессиональные программы –программы повышения квалификации,  Стаж менее 2-х лет в должности техника или других должностях, замещаемых специалистами со средним профессиональным образованием |  |  |
| А/02.5 | Проведение измерений параметров наноматериалов и наноструктур |
| А/03.5 | Проведение статистического анализа и составление протоколов измерений параметров наноматериалов и наноструктур |
|  |  |  |  | А/04..5 | Реализация мероприятий по повышению производительности и точности измерений параметров наноматериалов и наноструктур |  |  |  |  |